PAT-NO:

JP401302530A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01302530 A

TITLE:

SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISK AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE:

December 6, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME ARAI, YOSHIHIRO NAKAJIMA, KAN KOMATSUBARA, SHIGEMARU FUNAOKA, HIDEHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**TONEN CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP63134151

APPL-DATE:

May 30, 1988

INT-CL (IPC): G11B005/82, G11B005/704, G11B005/84

# ABSTRACT:

PURPOSE: To produce the substrate having a CSS characteristic with good reproducibility by injection molding a thermoplastic resin and forming nonconcentrical patterns of ≤300Å groove depth on a magnetic disk surface by using a die or stamper.

CONSTITUTION: A polyether imide resin, etc., having 150∼450°C glass transition temp., etc., are used as the thermoplastic resin and said resin is injection molded by using the stamper formed with the nonconcentrical, for example, radial grooves having 80Å depth, 150Å width and 330Å spacing. A Ti metal film is formed by a sputtering method on this surface as a substrate and further, a magnetic metal consisting of Co-Ni-Cr, etc., is deposited by a sputtering method or plating method, etc., to form the magnetic disk. The ratio at which a magnetic head crosses the patterned grooves is increased in this way and the air layer is efficiently formed between the magnetic head and the disk, by which the CSS characteristic is improved with the good reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### 平1-302530 ② 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)12月6日

G 11 B

5/82 5/704 5/84

7350-5D 7350 - 5D

Z-6911-5D審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

磁気デイスク用基体およびその製造法 60発明の名称

> 创特 91 昭63-134151

昭63(1988)5月30日 29出 頭

@発 明 者 荒 井 芳 博

茂 丸

東京都北区西ケ原4丁目5番8号

@発 明 者 ф 息 完

埼玉県浦和市大字太田窪2244番地の92

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号

明 小 松 原 @発 者

埼玉県入間郡大井町大字亀久保952番地の3 三友コーボ

205号

@発 明 者 徭 图

英 彦 埼玉県上福岡市西原1丁目5番地18 東燃上福岡寮

東亜燃料工業株式会社 ②出 顖 人

弁理士 鈴木 俊一郎 何代 理 人

#### 明 र्मःशा

### 1. 発明の名称

磁気ディスク用基体およびその製造法

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 表面に清深さ300 A以下の非同心円状パ ターンが形成されている熱可塑性樹脂からなるこ とを特徴とする磁気ディスク用基体。
- (2) 消获さ300歳以下の非同心円状パターンを 有する金型またはスタンパーを使用して、熱可塑 性樹脂を射出成形することにより、該射出成形体 **表面に清深さ300~以下の非同心円状パターン** を形成することを特徴とする磁気ディスク用基体 の製造法。

# 3. 発明の詳細な説明

### 死明の技術分野

本発明は磁気ディスク用基体およびその製造法 に関し、さらに詳しくは、電磁変換特性に使れる 記録何が、蒸着法またはメッキ法で形成される薄 股型磁気ディスク媒体に用いられる基体およびそ

## の製造法に関する。

# 発明の技術的背景ならびにその問題点

従来から、磁気ディスク媒体として、AI基体 上に、磁性粉がポリウレタン等の有機パインダー に分散された磁性塗料を塗布することにより記録 層を形成した磁気ディスク媒体(塗布タイプの磁 気ディスク媒体)が使用されている。 じかしなが ち、このような磁気ディスク媒体は、磁性粉を A』基体上に保持するために有機パインダーを用 いることが必要であるので、このような風気ディ スク媒体では、昨今の高密度記録化に対応するこ とが困難になりつつある。

そこで、基体上に磁性材料を真空蒸発法または メッキ法を利用して薄膜状に被着させた記録層を 有する磁気ディスク媒体(薄膜型磁気ディスク媒 体)が注目されている。このような薄膜型磁気 ディスク媒体は、配録層に有機パインダーが含ま れていないので、高密度記録に適している。

また薄膜型磁気ディスク媒体においては、記録 層が薄いために、基体の表面の状態が殆どそのま

ま薄膜型磁気ディスク媒体の表面の状態になる。 このため、例えばA』を用いて薄膜型磁気ディス ク媒体用の基体を製造するためには、表面の状態 を一定に維持することが必要になり、製造工程に 駐しい防塵対策を絶す等、野大な設備投資が必要 となる

すなわち、A』を用いて薄膜型磁気ディスク媒体用の基体を製造しようとすると、鋳造、鉄塊の均質化処理、熱間圧延、冷間圧延、サークル打ち抜き、矯正軟化処理、精密切削、精密研磨処理等のように非常に複雑な製造工程を経ることが必要になるという同価がある。

ところで、上記のような磁気ディスク媒体においては、磁気ディスク媒体表面と磁気ヘッドとは非常にわずかな空隙を形成しながら定行する。このような空隙は、磁気ディスク媒体を走行させることにより、磁気ディスク媒体表面に一定の空気流によって磁気ヘッドを磁気ディスク媒体表面から浮上させることにより形成される。従って、磁気ディスクの表面は、良好

充分には向上しないという問題点を有している。 <u>発明の目的</u>

本発明は、上記のような従来技術に伴う問題点を解消しようとするものであって、良好なCSS特性を有する磁気ディスク媒体を製造することができる磁気ディスク用基体およびこの磁気ディスク用基体を製造する方法を提供することを目的としている。

### 発明の概要

本発明に係る磁気ディスク用基体は、表面に清 深さ300人以下の非同心円状パターンを有する 熱可塑性樹脂からなることを特徴としている。

また、本発明に係る磁気ディスク用基体の製造方法は、清深さ300人以下の非同心円状パターンを有する金型またはスタンパーを使用して、熱可塑性樹脂を射出成形することにより、該射出成形体表面に清深さ300人以下の非同心円状パターンを形成することを特徴としている。

本発明の磁気ディスク用基体を用いることにより得られる磁気ディスクは、非常に良好なCSS

な空気流を形成するように凹凸が形成されている ことが必要であり、かつこの凹凸によって磁気 ヘッドが損傷を受けないように形成されているこ とが必要である。

したがって、AIを基体として用いる場合には、 CSS特性(コンタクト・スタート・ストップ特 性)を向上させるために、ダイヤモンド若しくは アルミナ等の砥粒、研磨紙または研磨テープ等を 用いて基体表面上にテクスチャー加工を行なって いる

しかしながら、このようなテクスチャー加工においては、A』 基体を回転させながら表面を加工するために、得られるA』 基体表面には同心円状のパターン溝しか形成することができず、しかも、このテクスチャー加工によって得られる基体は、パターン形状の再現性が低いうえに、パターン形状を変更することは不可能である。

また、このようにして得られたA」基体を用いて製造された薄膜型磁気ディスク媒体は、電磁変換特性等の特性が一定せず、さらにCSS特性も

特性を示す。また、本発明の磁気ディスク用基体を用いることにより、同心円状の溝を有する基体と比較すると、溝深さが浅くても同等の効果を有する磁気ディスク媒体を得ることができる。さらに、本発明の製造法によれば、従来法と比較してパターン形状の再現性が非常に良好な磁気ディスク基体を容易に製造することができる。

### 発明の具体的説明

次に本発明の磁気ディスク用基体およびこの磁 気ディスクを製造する方法について具体的に説明 する。

本発明者らは、熱可塑性樹脂を、所定のパターンを形成した金型またはスタンパーを使用して射出成形することにより、非同心円状のパターンを設けた磁気ディスク用基体を製造することができ、このようにして形成した基体を用いて磁気ディスクを製造したところ、CSS特性が向上するとともにパターン形状の再現性が非常に高いことおよび清のパターンを非同心円状にすることを見出した。

すなわち、本発明に係る磁気ディスク用基体は、 従来の基体とは異なり、熱可塑性閉脂から構成さ れており、この熱可塑性樹脂の表面には、溝深さ 300点以下の非同心円状パターンが形成されて いる

### [熱可塑性閉路]

本発明で用いられる熱可塑性樹脂としては、磁性金属の蒸着時等に熱変形を起さないようにするためには、ガラス転移温度が150で以上である樹脂を用いることが好ましく、さらに成形性を労成すると、ガラス転移温度が150~450℃の範囲内にある樹脂を用いることが特に好ましい。

また、磁気ディスク媒体の耐久性を考慮すると、 熱可塑性樹脂の引張り強度は、700kg/cd以上 であることが好ましい。

このような特性を有する樹脂として、例えばポリアリレート樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリエーテルエーテルケトン樹脂等が挙げられる。このうち溶

分から周辺部に向って放射状に溝のバターンを形成することもでき、さらに放射状に直方形の溝を並べた形状でも良い。

上記のような金型あるいはスタンパーに形成されている溝の深さは300k以下であり、特に250k以下であることが好ましい。

このような金型あるいはスタンパーを用いることにより、表面に上記金型あるいはスタンパーに形成された消に対応した溝が形成される。 すなわち、この溝の深さは300点以下であり、250点以下であることが好ましい。溝の深さが300点を超えると、この磁気ディスク用基体を用いて得られる磁気ディスクの電磁変換特性の劣化が増大するので好ましくない。

酸流動性等の加工特性の良いポリアリレート樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂およびポリエーテルスルホン樹脂を使用することが好ましい。

### [磁気ディスク用基体]

本発明の磁気ディスク用基体は、上記のような 熱可塑性樹脂を用いて射出成形する際に、パター ンを設けた金型またはスタンパーを用いて射出成 形体の表面に、非同心円状のパターンを形成する ことにより製造することができる。

本発明においては、金型またはスタンパーのいずれをも使用することができる。

すなわち、金型またはスタンパーを使用する場合には、磁気ディスク用基体を形成し得るように 金型またはスタンパーをセットし、この金型また はスタンパーにより形成された空間に上記の独可 塑性樹脂を射出して成形を行なう。

金型またはスタンパーに形成されるパターン清 形状は同心円状以外の所型の形状にすることがで きる。例えば第1図に示すように、基体の中心部

この場合に使用することができる非磁性金属としては、チタン、クロム、タングステン、モリブデンなどを挙げることができ、また非磁性無機物としては、窒化チタン、炭化チタン、ダイヤモンド状カーボンなどを挙げることができる。さらに有機高分子としては、アセタール樹脂、アクリレート樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂、エボキシ樹脂などを挙げることができる。

このような非磁性金属薄膜、非磁性無機物薄膜 または有機高分子薄膜の厚さは、通常200Å~ 20μmの範囲内にある。

このようにして得られた磁気ディスク用基体に、 蒸着法あるいはメッキ法により磁性金属を被着す ることにより薄膜型磁気ディスクを得ることがで きる。

なお、上記のようにして磁性金属からなる記録 層を設けた後、この記録層上に、ステアリン酸な どの調滑剤を塗布して潤滑剤層を設けることが好ましい。

このように非同心円状のパターン溝を有する磁

気ディスク用基体を用いて製造された磁気ディスクは、記録層の表面に磁気ディスク用基体の表面に磁気ディスク用基体の表面に磁気ディスク用基体の表面に対応した非同心円状のパターン清が形成された是来の磁気ディスクを用いた場合よりも、磁気へッドと磁気ディスクを開いた場合よりも、磁気へッドと磁気ディスクとの間に効率よく空気層を形成することができるために、結果としてCSS特性が向上する等の効果が生ずるものと方えられる。

# 発明の効果

本発明に係る磁気ディスク用基体を用いて製造された磁気記録媒体は、CSS特性等の特性が向上するとともに、パターン形状の再現性が非常によい。従って、得られる磁気ディスクのCSS特性が向上する。

さらに、本発明に係る磁気ディスク用基体の製造法においては、所定のパターンを設けた金型またはスタンパーを使用することにより、容易に、かつ清形状の再現性のよい磁気ディスク用基体を

ク用基体を得た。

この基体上に、スパッタリング法を利用して、 Co-Ni-Crからなる記録層を800人の厚 さに形成し、さらにその上にステアリン酸を塗布 して調滑利層を形成し、磁気ディスクを得た。

回転数3600rpm にて、この磁気ディスクの CSS特性を測定したところ、1,000,000 回で あった。

# 比較例1

実施例1において、放射線状の溝パターンを有するスタンパーの代わりに、同心円状の溝パターンを有するスタンパーを使用した以外は実施例1と同様にして磁気ディスクを製造した。

実施例1と同様の方法にてCSS特性を測定したところ、80,000回であった。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の磁気ディスクの一例を示す 平面図である。

第2回は第1回に示した磁気ディスクの表面の 拡大関である 製造することができる。また、基体には熱可塑性 樹脂を用いるため、基体を含めた磁気ディスクを 軽量にすることができ、従って、モーターの小型 化および/またはハードディスクドライブの大容 量化を図ることができる。

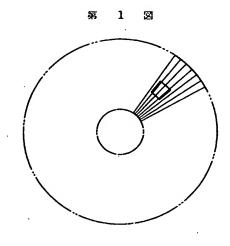
以下、本発明を実施例によりさらに詳しく説明 するが、本発明は、これらの実施例によって限定 されるものではない。

#### 実施例 1

熱可塑性樹脂としてポリエーテルイミド樹脂を 用いて、放射状のパターンが形成してあるスタン パーを使用して射出成形を行なった。

得られた成形体は、直径130mの円盤状であり、円盤表面に第1および第2回に示すような放射状の深さ80点、幅150点、同隔330点の消が形成されていた。

このようにして成形体を3000枚成形したが、 清形状が規格外であるものは6%以内であった。 該成形体上にスパッタリング法によりTi金取版 をさらに5000よの厚さで形成して磁気ディス



第 2 図

